



(12) 发明专利 (扉页更正)

(10) 授权公告号 CN 106536403 B8

(45) 授权公告日 2019. 07. 02

(48) 更正文献出版日 2019. 08. 20

(21) 申请号 201580027564. 7

(22) 申请日 2015. 07. 10

(85) PCT国际申请进入国家阶段日
2016. 11. 25

(86) PCT国际申请的申请数据
PCT/US2015/030158 2015. 05. 11

(87) PCT国际申请的公布数据
W02015/183534 EN 2015. 12. 03

(73) 专利权人 3M 创新有限公司
地址 美国明尼苏达州

(72) 发明人 P·J·伯杰龙 B·D·伦塞弗德
J·D·盖辛格 D·B·冈德尔
J·A·莫奈伊 R·帕拉尼斯瓦米
符祥心

(74) 专利代理机构 北京市金杜律师事务所
11256
代理人 李辉 董典红

(51) Int. Cl.
B81B 3/00(2006. 01)
B81C 1/00(2006. 01)

(56) 对比文件

US 2005/0000932 A1, 2005. 01. 06, 说明书第
31-36 段, 附图 9-13.

CN 101640977 B, 2013. 04. 24, 全文.

CN 102074648 B, 2015. 04. 15, 全文.

审查员 杨靖

权利要求书 2 页 说明书 13 页 附图 14 页

(54) 发明名称

柔性基底上的微机电系统装置

(57) 摘要

本发明描述了一种包括一个或多个 MEMS 元件的柔性膜, 以及包括所述柔性膜的制品。所述柔性膜包括在两个金属层之间的聚合物层, 其中所述金属层中的一者包括穿孔。所述聚合物层包括空隙区域, 从而允许所述两个金属层发生相对运动。

